

走査電子顕微鏡の像形成と 材料評価への応用

2024年

7月25日(木)

15:00~16:30

Teams
開催

定員
100名

主催
産総研
中国センター

産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター

熊谷 和博 主任研究員

走査電子顕微鏡(SEM)は幅広い分野で重要な観察ツールであり、近年ではハード・ソフトの進歩により多彩な情報が得られるようになりました。その一方で、得られた像の解釈に迷う場合も少なくありません。そこで、本講演では、SEMの像形成メカニズムについて考えます。SEMの中で何が起きているのか、その結果どのような情報もった像が得られるのか、事例を交えながら議論します。



申込締切: 7月23日(火)まで

申込フォーム:

<https://forms.office.com/r/JyduWB2mac>

オンライン視聴に必要なリンク情報等を記載した招待メールを
開催日前日までに送付いたします。

